


**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 115**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 17 z/of 21.05.2024

 AP 115	Nazwa i adres / Name and address POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE Sp. z o.o. ul. Kokoszycka 172C 44-300 Wodzisław Śląski
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) i/lub poza nią (P) / at permanent location (S) and/or outside of permanent location (P)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand ¹⁾ 6.01 długość 14.02 wilgotność 19.01 temperatura (termometria elektryczna)

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 115 z dnia 06.04.2020 r.
Cykl akredytacji od 21.05.2024 r. do 27.05.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 115 of 06.04.2020
Accreditation cycle from 21.05.2024 to 27.05.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

POL-EKO Laboratorium Pomiarowe Sp. z o.o. ul. Kokoszycka 172C, 44-300 Wodzisław Śląski				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Sita kontrolne laboratoryjne	(0,02 ÷ 10) mm (10 ÷ 50) mm (50 ÷ 125) mm	3 µm 50 µm 110 µm	S	Procedura wewnętrzna PLP-SL w oparciu o PN-ISO 3310-1:2000 PN-ISO 3310-2:2000 Pomiar za pomocą współrzędnościowego mikroskopu pomiarowego
Sita prętowe	(2,5 ÷ 10) mm (10 ÷ 50) mm	3,0 µm 50 µm		Procedura wewnętrzna PLP-SL w oparciu o PN-EN 933-3:2012 Pomiar za pomocą współrzędnościowego mikroskopu pomiarowego
Sita kosz z tkaniny z drutu	(0,02 ÷ 0,5) mm	3 µm		Procedura wewnętrzna PLP-SL w oparciu o PN-ISO 3310-1:2000 Pomiar za pomocą współrzędnościowego mikroskopu pomiarowego
Sita kontrolne laboratoryjne	(10 ÷ 50) mm (50 ÷ 125) mm	50 µm 110 µm		Procedura wewnętrzna PLP-SL w oparciu o PN-ISO 3310-1:2000 PN-ISO 3310-2:2000 Pomiar za pomocą suwmiarki
Sita prętowe	(10 ÷ 50) mm	50 µm		Procedura wewnętrzna PLP-SL w oparciu o PN-EN 933-3:2012 Pomiar za pomocą suwmiarki
Wilgotność względna				
Termohigrometry	(22 ÷ 98) %rh w zakresie temperatur (10 ÷ 20) °C (20 ÷ 98) %rh w zakresie temperatur (20 ÷ 40) °C (20 ÷ 80) %rh w zakresie temperatur (40 ÷ 60) °C	2,5 %rh	S	Procedura wewnętrzna PLP-RH
Komory klimatyczne	(22 ÷ 98) %rh w zakresie temperatur (10 ÷ 20) °C (20 ÷ 98) %rh w zakresie temperatur (20 ÷ 40) °C (20 ÷ 80) %rh w zakresie temperatur (40 ÷ 60) °C	3,0%rh ¹⁾	S, P	Procedura wewnętrzna PLP-KK

Wersja strony: A

Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Temperatura (termometria elektryczna)				
Komory klimatyczne Komory termostatyczne Wzorcowanie i pomiar	(-80 ÷ -25) °C (-25 ÷ 200) °C	0,5 °C ¹⁾ 0,15 °C ¹⁾	S, P	Procedura wewnętrzna PLP-BRT, PLP-PRT
Termostaty cieczowe	(-25 ÷ 200) °C	0,15 °C ¹⁾	S, P	Procedura wewnętrzna PLP-LW
Piece	(100 ÷ 1100) °C	3,0 °C ¹⁾	S, P	Procedura wewnętrzna PLP-PL
Komory do sterylizacji parowej (autoklawy, aparaty Kocha itp.)	(60 ÷ 140) °C	0,5 °C ¹⁾	P	Procedura wewnętrzna PLP-AT
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne)	(-80 ÷ -25) °C (-25 ÷ 80) °C (80 ÷ 200) °C (200 ÷ 1100) °C	0,2 °C 0,05 °C 0,06 °C 2,5 °C	S	Procedura wewnętrzna PLP-TE
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne)	(-80 ÷ 200) °C (200 ÷ 1000) °C	0,2 °C 2,5 °C	P	Procedura wewnętrzna PLP-TE
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) Termometry elektryczne (z rejestracją temperatury)	(0 ÷ 60) °C (60 ÷ 140) °C	0,2 °C 0,3 °C	S	Procedura wewnętrzna PLP-RT

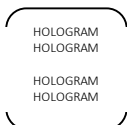
Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

¹⁾ Wartość niepewności pomiaru dla CMC dotyczy pojedynczego punktu pomiarowego w przestrzeni urządzenia.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 115

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 21.05.2024 r.